



NEW MULTI-FUNCTIONAL MICRO- AND NANOIMPRINT SOLUTION FROM EV GROUP OFFERS UNPRECEDENTED FLEXIBILITY FOR HIGH-VOLUME OPTICAL DEVICE MANUFACTURING – January 19, 2022

EV Group (EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, today introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. This industry-ready, multi-functional system is designed to serve advanced R&D and production needs for a wide range of emerging applications involving micro- and nano-patterning as well as functional layer stacking.

新闻中心 手机数码 智能硬件 生活服务 创业投资 区块链

EV集团新型多功能微纳米压印解决方案为大批量光学设备制造
赋予前所未有的灵活性

新闻中心 | 01-19 | 阅读: 1235 | 评论: 0

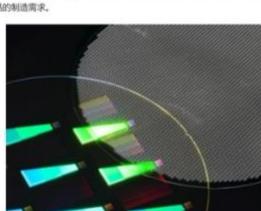
EVG®7300是EV集团最新的解决方案。能够在单个平台中结合多种紫外光刻工艺，包括纳米压印光刻（NIL）、膜片成型和晶圆叠合（嵌线组合）。这将面向行业的多性能系统旨在满足多种新兴应用的开发和生产需求。这些新兴应用大多涉及微米和纳米图案成型以及功能层堆叠技术，包括晶圆级光学系统（WLO）、光电器件和投影仪、汽车照明、增强现实耳机、生物医学设备、超透镜和晶圆表面，以及光电子学应用。EVG7300支持最大300毫米晶圆尺寸，具有高精度需求，先进工艺控制和高吞吐量等优势，可满足多种自由曲面和高精度纳米和微光学元件与器件的大批量制造需求。



EVG®7300自动化SmartNIL®纳米压印与晶圆级光学系统在单个平台上结合了多种紫外光刻技术，是一套先进的多性能解决方案。

EV集团企业技术总监托马斯·格林斯纳（Thomas Glinser）表示：“EV集团深耕纳米压印技术领域二十多年，我们继续在这一重要领域开拓创新，开发出新型解决方案，满足不断变化的客户需求。EVG7300是EV集团的纳米压印解决方案系列的最新成员，将我们的SmartNIL全集成技术与透镜成型和透镜堆叠技术结合在一起。拥有市场上最精确的离焦和工艺参数控制功能，为我们的客户提供前所未有的灵活性，以满足行业研究和生产需求。”

EVG7300系统既可用作独立工具，也可用作EV集团HERCULES® NIL全集成型UV-NIL层压解决方案中的集成模块。UV-NIL解决方案可添加额外的处理步骤，例如清洁过程、抗反射涂层、烘烤或湿处理，以满足特定工艺的优化需求。EVG7300系统结合了标准干台步进、高精度光学、多点间隙控制、非接触式间隙检测和多点控制等技术，达到了业内领先的离焦精度（最低±0.300微米）。EVG7300提供一个高度灵活的平台，提供三种工艺模式（透镜成型、透镜堆叠和SmartNIL纳米压印），支持从150毫米到300毫米晶圆的基本尺寸。该高产平台能够快速加载晶圆和晶圆，快速调准光学器件，提高高精度透镜化功能，且工具尺寸小巧，能够充分满足行业对新型晶圆级光学系统（WLO）产品的制造需求。



SmartNIL®配备了增强版光学透镜和晶圆成型掩模头压印功能，使新的EVG 7300系统拥有广泛的应用场景。

产品上市信息

EV集团现已开始接受该系统的订单，同时，可在EV集团总部的NIL Photonics®技术中心观看产品演示。

关于 EV 集团(EVG)

EV集团（EVG）是为半导体、微机电系统（MEMS）、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造商提供工艺与材料解决方案的领先供应商。主要产品包括：晶圆键合、晶圆照相、光刻/光刻胶纳米压印（NIL）与计量设备，以及光刻胶涂布机、清洗机和检测系统。EV集团成立于1980年，可为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。